See the notice on TED website

Sverige-Stockholm: Mikroelektroniska maskiner, apparater och mikrosystem
OJ S 133/2019 12/07/2019
Meddelande om tilldelning av kontrakt
Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Kungliga Tekniska högskolan
Nationellt registreringsnummer: 202100-3054
Postadress: Brinellvägen 8
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 100 44
Land: Sverige
Kontaktperson: Marina Busk
E-post: mbusk@kth.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kth.se

I.4. Typ av upphandlande myndighet

Statligt organ eller förbundsorgan

I.5. Huvudsaklig verksamhet

Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning

II.1.1. Benämning på upphandlingen

Procurement of a Vapour Hydrofluoric Acid (HF) Etcher
Referensnummer: V-2019-0242

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

31712000 Mikroelektroniska maskiner, apparater och mikrosystem

II.1.3. Typ av kontrakt

Varor

II.1.4. Kort beskrivning

KTH intends to purchase one etching instrument that uses anhydrous hydrofluoric acid (aHF) vapour to etch sacrificial silicon dioxide (SiO#) in the release etch of microelectromechanical (MEMS) devices.
The content of this invitation to tender is an upgrade of the KTH clean-room free-etching capabilities.
The activities of the main users of this tool are primarily focussing on microfabrication of MEMS and photonics devices.

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2. Beskrivning

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

31000000 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning, 31712330 Halvledare, 42000000 Industrimaskiner, 42900000 Diverse allmänna maskiner och specialmaskiner

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE110 Stockholms län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

The principal application of the procured instrument is to employ anhydrous hydrofluoric acid (aHF) for etching sacrificial silicon dioxide (SiO#) with very high selectivity, and without stiction, in the release etch of microelectromechanical (MEMS) devices made in silicon (Si), poly-Si, and aluminium (Al) structural materials. The new aHF instrument will primarily be used for research and development of the release of silicon MEMS devices on silicon on insulator (SoI) wafers.

The offered instrument must be a complete vapour hydroflouric acid (HF) etcher of clean-room grade.

The instrument must be offered with a suitable maintenance kit for two years of planned instrument maintenance without extra cost.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

1) A suitable process vacuum pump for the instrument;

2) A suitable HF abatement unit (scrubber).

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2. Administrativ information

IV.2.1.

Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 100-241728

IV.2.8. Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

IV.2.9. Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar
Motivation for cancelling
The reason for cancellation is an insufficient degree of competition due to the fact that, only one tender is qualified, i.e. has fulfilled all mandatory requirements.
Visma notice: https://opic.com/id/affevqjfui

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige

VI.5. Datum då meddelandet sänts
10/07/2019